

# ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ

*И.Е.Батов, М.Р.Трунин*

*Институт физики твердого тела РАН  
142432 Черноголовка, Московская обл., Россия*

Поступила в редакцию 17 мая 1993 г.

Показано, что при анализе экспериментальных данных по микроволновому поглощению тонких ( $\sim 0,1$  мкм) пленок высокотемпературных сверхпроводников следует учитывать размерные особенности в поглощении, присущие металлическим пленкам с малой удельной проводимостью, нанесенным на диэлектрическую подложку.

1. Переменное магнитное поле частоты  $\omega$  проникает в нормальный металл с проводимостью  $\sigma$  на глубину скин-слоя  $\delta = c/(2\pi\omega\sigma)^{1/2}$ . Однако эффективное экранирование электромагнитной волны тонкими металлическими слоями осуществляется на значительно меньших толщинах  $d \ll \delta$ . В частности, металлическая пленка, помещенная в вакуум, служит хорошим экраном вплоть до критической толщины  $d_c = c/2\pi\sigma = 2\pi\delta^2/\lambda_0$  ( $\lambda_0$  – длина волны в вакууме) [1], при которой потери в пленке максимальны;  $d_c$  есть фундаментальная длина, которая непосредственно входит в уравнение Максвелла  $\operatorname{rot}H = \frac{4\pi}{c}\sigma E + \frac{1}{c}\frac{\partial D}{\partial t}$ .

Для меди при комнатной температуре  $\sigma_{\text{Cu}} = 5 \cdot 10^{17} \text{ с}^{-1}$ , так что  $d_{c,\text{Cu}} \sim \sim 10^{-8} \text{ см}$ . Однако в последнее время все большую роль в практике физических экспериментов и приложений приобретают металлы с малой удельной проводимостью  $\sigma \leq \sigma_{\text{Cu}}/100$ ; для них размер  $d_c$  возрастает до нескольких сотен ангстрем. В данной работе обращается внимание на то, что для пленок, напыленных на диэлектрическую подложку, критическая толщина может увеличиться до размеров  $\sim 1000 \text{ \AA}$ . Тогда она сравнивается с реальными толщинами пленок, исследуемых экспериментально. Таковы, например, тонкие пленки высокотемпературных сверхпроводников, которые для толщин  $\sim 1000 \text{ \AA}$  получаются наиболее совершенными, а уровень остаточных потерь в них оказывается минимальным [2]. Из-за малой толщины таких пленок, сравнимой с критической, при анализе процессов диссипации в них необходимо учитывать эффекты, связанные с экранированием внешнего поля.

2. Пусть  $P$  – потери в пленке на единицу площади,  $P_i = cE_iH_i/8\pi$  – мощность падающей на пленку электромагнитной волны,  $E_i$  и  $H_i$  – амплитуды электрического и магнитного полей в падающей волне. При одностороннем возбуждении пленки, находящейся в вакууме, в зависимости поглощения  $P$  от толщины  $d$  пленки имеются две особенности: максимум при  $d = d_c \ll \delta$  [1] и минимум при  $d = \pi\delta/2$ . Амплитуды этих особенностей, нормированные на величину потерь  $P_0$  в толстой ( $d \gg \delta$ ) пленке, существенно различны, как видно из кривой 1 на рис.1.

Электрическое поле в тонкой ( $d \ll \delta$ ) пленке распределено однородно. Амплитуда поля  $E = E_id_c/(d + d_c)$  монотонно убывает по мере увеличения толщины  $d$ . При этом потери в пленке  $P = \sigma E^2 d/2$  растут при  $d < d_c$  и падают при  $d > d_c$ . Таково происхождение максимума в потерях при  $d = d_c$ . Если  $d < d_c$ , то пленка становится почти полностью прозрачной для падающей

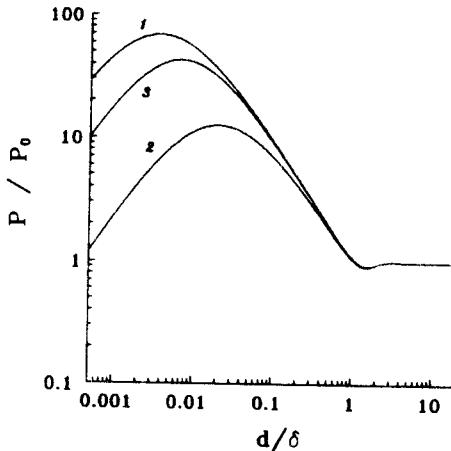


Рис.1

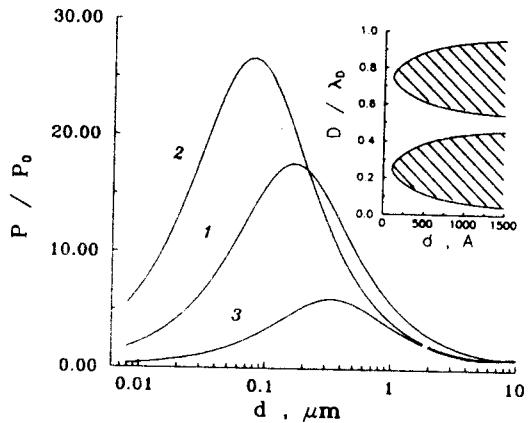


Рис.2

Рис.1. Зависимости потерь  $P/P_0 (d/\delta)$  для пленки толщиной  $d$  с удельным сопротивлением  $\rho = 1/\sigma = 400$  мкОм·см, облучаемой электромагнитной волной на частоте  $f = 30$  ГГц: 1 – пленка без подложки в вакууме или пленка на диэлектрической ( $\epsilon = 10$ ) подложке толщиной  $D$ , кратной половине длины волны в диэлектрике:  $D = \lambda_D n/2$ ; 2 – та же пленка на подложке толщиной  $D = \lambda_D(2n + 1)/4$ ; 3 – промежуточное значение  $D = 0.4\lambda_D$

Рис.2. Зависимости  $P/P_0 (d)$  для разных частот и толщин подложки ( $\rho = 400$  мкОм·см;  $\epsilon = 16$ ): 1 –  $f = 30$  ГГц,  $D_0 = 0.1$  мм; 2 –  $f = 60$  ГГц,  $D_0 = 0.1$  мм; 3 –  $f = 60$  ГГц,  $D = 0.6$  мм. Линии на вставке соответствуют зависимостям  $d_{max}(D/\lambda_D)$  из (2). Не заштрихованы области прозрачности ( $d < d_{max}$ ) пленки

электромагнитной волны, при  $d > d_c$  большая часть мощности падающей волны отражается от пленки.

Рассмотрим теперь поглощение волны в пленке, нанесенной на диэлектрическую подложку толщиной  $D$ . Диэлектрическая проницаемость подложки равна  $\epsilon$ , потерями в ней пренебрегаем. Зависимости  $P/P_0 (d/\delta)$ , полученные в результате стандартного решения уравнений Максвелла с граничными условиями для такой структуры, приведены на рис.1. Если толщина подложки  $D = \lambda_D n/2$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $\lambda_D = \lambda_0/\epsilon^{1/2}$  – длина волны в диэлектрике), то в поглощении пленки имеется тот же максимум при  $d = d_c$  (кривая 1). При  $D = \lambda_D(2n + 1)/4$  амплитуда максимума уменьшается в несколько раз, а его положение достигает величины  $d = d_c(\epsilon + 1)/2$  (кривая 2). Для других значений  $D$ , не равных  $\lambda_D n/4$ , амплитуда и положение этого максимума имеют промежуточные значения (кривая 3).

Например, epitаксиальные пленки YBaCuO напыляются на диэлектрические подложки, проницаемость  $\epsilon$  которых меняется примерно от 10 ( $MgO$ ,  $Al_2O_3$ ) до 24 ( $LaAlO_3$ ), а тангенс угла потерь  $tg\kappa \leq 10^{-5}$  [3]. При комнатной температуре удельное сопротивление  $\rho_{YBaCuO} \simeq 400$  мкОм·см, так что в зависимости от размера подложки  $D$  критическая толщина такой пленки изменяется от  $d_c \simeq 200 \text{ \AA}$  до  $d_c(\epsilon + 1)/2 \geq 1000 \text{ \AA}$ .

Еще большее значение критической толщины получается в том случае, когда подложка ограничена с задней стороны металлическим экраном, отражающим почти все падающее на него излучение. Тогда максимальное

критическое значение  $d = \pi\delta/2$  при толщине подложки  $D = \lambda_D n/2$ . Амплитуда максимума  $P(\pi\delta/2) \simeq 1,09P_0$ . За исключением значений  $D$  в очень малых окрестностях вблизи  $\lambda_D n/4$ , равных глубине скин-слоя в пленке, зависимость поглощения  $P$  от толщины  $d$

$$P(d) = P_0 \delta d / (d^2 + dd_c + d_{max}^2) \quad (1)$$

имеет максимум, положение и величина которого определяются выражениями

$$d = d_{max} = d_c(1 + \epsilon \operatorname{ctg}^2 \alpha)^{1/2}/2, \quad P = P_{max} = P_0 \delta / (d_c + 2d_{max}), \quad (2)$$

где  $\alpha = 2\pi D/\lambda_D$ . Зависимости  $P(d)$  совпадают для любых толщин  $D$  из набора

$$D_0 = |D - \lambda_D n/2|, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad 0 < D_0 < \lambda_D/4, \quad (3)$$

так что при  $n = 1$ , например,

$$P(d, \lambda_D/2 + D_0) = P(d, \lambda_D/2 - D_0) = P(d, D_0). \quad (4)$$

Зависимость амплитуды и положения максимума (2) от частоты падающей волны и толщины подложки содержится в  $\operatorname{ctg}^2 \alpha$ . Характерное представление о масштабах  $P_{max}$  и  $d_{max}$  дают зависимости  $P/P_0(d)$  на рис.2. Обратим внимание, что при заданной частоте положение максимума в поглощении "регулируется" надлежащим выбором толщины подложки  $D$ .

Выразив величины  $P_0$ ,  $\delta$ ,  $d_c$  и  $d_{max}$  в (1) через  $\sigma$ , получим, что при изменении проводимости пленки  $\sigma(T)$  в потерях

$$P \propto \sigma / (\sigma^2 + \sigma \sigma_0 + \sigma_{max}^2), \quad \sigma_0 = c/2\pi d, \quad \sigma_{max} = \sigma_0(1 + \epsilon \operatorname{ctg}^2 \alpha)^{1/2}/2 \quad (5)$$

имеется максимум при  $\sigma = \sigma_{max}$ . Из (2), (5) следует, что температурный ход потерь в массивном образце будет отличаться от зависимости поглощения  $P(T)$  для тонкой пленки в области прозрачности (при  $d < d_{max}$  на вставке рис.2). На вставке рис.3 для трех значений  $d$  приведены кривые  $P(T)/P_0(300 \text{ K})$  в предположении, что удельное сопротивление пленки  $\rho = 1/\sigma$  пропорционально температуре:  $\rho = AT$ ,  $A = 1,5 \text{ мкОм}\cdot\text{см}/\text{К}$ . При уменьшении толщины пленки убывающая по мере понижения температуры зависимость сменяется возрастающей. Заметим, что вне области прозрачности потери в тонкой пленке очень велики (штриховая кривая 4).

Таковы простейшие проявления особенностей экранирования поля пленкой, находящейся в нормальном состоянии.

3. Если в рассматриваемой нами структуре с уменьшением температуры пленка переходит в сверхпроводящее состояние при  $T = T_c$ , то ее проводимость становится комплексной:  $\sigma_s = \sigma_{1s} - i\sigma_{2s}$ . Например, в двухжидкостной модели

$$\sigma_{1s} = \sigma_n (T/T_c)^4, \quad \sigma_{2s} = c^2 / 4\pi\omega\lambda_L^2(T) = c^2 [1 - (T/T_c)^4] / 4\pi\omega\lambda_L^2(0), \quad (6)$$

где  $\sigma_n$  – проводимость при  $T = T_c$ ,  $\lambda_L(T)$  – глубина проникновения поля в сверхпроводник при  $T < T_c$ . За исключением очень близких к  $T_c$  температур отношение  $\sigma_{1s}/\sigma_{2s} \ll 1$ . Как и в нормальном состоянии, при  $T < T_c$  в поглощении  $P(d)$  имеется максимум  $P_m = P_0 \lambda_L / (d_m + d_{cs} \epsilon^{1/2} \operatorname{ctg} \alpha)$  при

$$d = d_m = d_{cs} (1 + \epsilon \operatorname{ctg}^2 \alpha)^{1/2}, \quad d_{cs} = 2\pi\lambda_L^2 / \lambda_0. \quad (7)$$

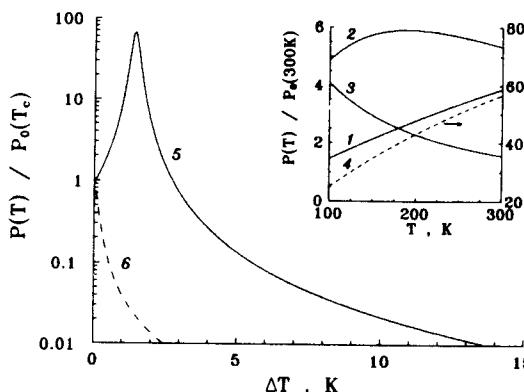


Рис.3. Зависимости  $P(T)$  в нормальном и сверхпроводящем состояниях пленки на частоте 60 ГГц. На вставке кривые 1–3 построены для  $d = 10000 \text{ \AA}$ ,  $2400 \text{ \AA}$ ,  $500 \text{ \AA}$ , соответственно, и при параметрах подложки  $D = 0,6 \text{ мм}$ ,  $\epsilon = 16$ . Штриховой линией 4 изображен температурный ход потерь для тонкой ( $d = 500 \text{ \AA}$ ) пленки вне области прозрачности ( $D = 0,3 \text{ мм}$ ). На рисунке  $\Delta T = T_c - T$ ,  $T_c = 90 \text{ K}$ ; кривая 5:  $d = 300 \text{ \AA}$ ,  $D = 0,5 \text{ мм}$ ,  $\epsilon = 24$ . Потери в такой пленке значительно превышают потери в массивном образце (кривая 6, рассчитанная в двухжидкостной модели)

Однако из-за различия проводимостей  $\sigma_s$  и  $\sigma_n$  и глубин проникновения  $\lambda_L$  и  $\delta$  размерные особенности в нормальном и сверхпроводящем состояниях пленки проявляются по-разному:

а) при  $T < T_c$  не выполняются равенства (4), и амплитуда максимума при толщинах подложки

$$\lambda_D(2n+1)/4 < D < \lambda_D(n+1)/2 \quad (8)$$

существенно больше, чем при других значениях  $D$ ;

б) при  $T < T_c/2$  величина  $\lambda_L(T) \approx \lambda_L(0) \ll \delta$ . Поэтому в (7)  $d_m \ll d_{max}$  из (2), и для реальных толщин  $d > d_m$  пленок имеет смысл говорить лишь об увеличении потерь  $P(d)$  при  $d \leq \lambda_L(0)$ ;

в) при  $T > T_c/2$  и приближении к  $T_c$  из-за резкого роста  $\lambda_L(T)$  в зависимости  $P(T)$  особенность (7) проявляется в виде узкого максимума, заметного при толщинах подложки  $D$  из интервалов (8). График  $P(T)/P_0(T_c)$ , рассчитанный в двухжидкостной модели (6), показан на рис.3 (кривая 5). Температура  $T_m$  в максимуме  $P$  определяется величиной  $\lambda_L(T_m) \approx (D_0 d)^{1/2}$ , где  $D_0$  находится из (3). При данном значении  $D_0$  разность  $T_c - T_m$  тем больше, чем меньше толщина пленки. Возможно, именно проявлением размерной особенности объясняется наблюдавшийся в эксперименте [4] максимум в зависимости микроволнового поглощения от температуры  $T < T_c$  для тонкой ( $d \approx 350 \text{ \AA}$ ) пленки BiSrCaCuO на подложке из MgO. Ширина максимума составляла несколько градусов, а его амплитуда превышала фоновый сигнал поглощения при  $T < T_c$  в десятки раз.

4. В литературе активно обсуждается вопрос о природе максимума в микроволновой проводимости  $\sigma_1(T)$  вблизи  $T_c$  в тонких пленках YBaCuO [5–8]. В эксперименте пленка на диэлектрической подложке помещается в волновод [5–7] или в резонатор в качестве оконечной нагрузки [8–10]. Мы хотим обратить внимание на то, что, определяя из этих измерений проводимость  $\sigma_1$ , необходимо учитывать специфику экранирования поля YBaCuO пленкой также и в случае, когда ее толщина  $d > \lambda_L(0) \approx 0,14 \text{ мкм}$ .

Пусть пленка на подложке занимает дно цилиндрического медного резонатора. Используя выражения (6), можно найти температурную зависимость импеданса  $Z = R + iX = 4\pi E(0)/cH(0)$  пленки при  $T \leq T_c$  ( $E(0)$  и  $H(0)$  – электри-

ческое и магнитное поля на поверхности пленки, сформированные в результате многократных отражений). Например, для пленки с  $\rho(100\text{ K}) = 150 \text{ мкОм}\cdot\text{см}$  и  $d = 0,25 \text{ мкм}$  независимо от толщины  $D < \lambda_D/2$  подложки поверхностное сопротивление  $R(T) \propto P(T)$  резко уменьшается при  $T \leq T_c$  и не имеет особенностей, что и наблюдается в экспериментах. Полагая теперь, что  $Z$  есть измеренный импеданс пленки, для вычисления проводимости  $\sigma_1$  воспользуемся обычным локальным соотношением  $Z = 2[i\pi\omega/(\sigma_1 - i\sigma_2)]^{1/2}/c$ . Тогда получим, что функция  $\sigma_1(T)$  немонотонна: она возрастает от  $T = T_c$ , достигает максимума при  $T \simeq 0,9T_c$ , а затем убывает, совпадая с  $\sigma_{1s}(T)$  из (6) при  $T < 0,7T_c$ . Такое поведение  $\sigma_1(T)$  вблизи  $T_c$  неадекватно истинной температурной зависимости проводимости  $\sigma_{1s}$ , пленки в исходно принятой для расчета  $Z$  модели (6) потому, что в данном примере непригодна стандартная связь  $Z$  и  $\sigma$ . В каждом конкретном случае при определении правильного соотношения между проводимостью тонкой пленки и измеряемыми величинами должны быть учтены эффекты экранирования поля пленкой в реальных условиях эксперимента.

Авторы благодарны В.Ф.Гантмахеру и В.А.Гражулису за интерес к работе, Г.И.Левиеву за критические замечания.

1. S.Fahy, C.Kittel, and S.G.Louie, Am. J. Phys. **56**, 989 (1988).
2. O.G.Vendik, Yu.V.Likholtov, S.F.Karmanenko, et al., Physica C **179**, 91 (1991).
3. T.Konaka, M.Sato, H.Asano, et al., J. Supercond. **4**, 283 (1991).
4. K.Sugawara, T.Sugimoto, D.J.Baar, et al., Physica C **185-189**, 2269 (1991).
5. P.H.Kobrin, J.J.Cheung, W.W.Ho, et al., Physica C **176**, 121 (1991).
6. F.A.Miranda, W.L.Gordon, K.B.Bhasin, et al., J. Appl. Phys. **70**(10), 5450 (1991).
7. D.Zhang, D.V.Plant, H.R.Fetterman, et al., Appl. Phys. Lett. **62**(11), 1298 (1993).
8. N.Klein, U.Dähne, U.Poppe, et al., Physica C **185-189**, 1777 (1991).
9. L.Drabeck, K.Holczer, G.Grüner, et al., J. Supercond. **3**, 317 (1990).
10. N.Klein, H.Chaloupka, G.Müller, et al., J. Appl. Phys. **67**, 6940 (1990).